## (19)日本国特許庁 (JP) ···

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002—16175 (P2002—16175A)

(43)公開日 平成14年1月18日(2002.1.18)

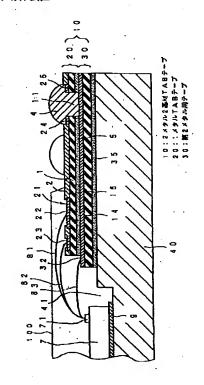
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	ΡI	デーマコート*(参考)
H01L 23/12		H01L 23/12	501F 5F044
	5 0 1		501W
		21/60	301A
. 21/60	301	23/12	N
			E
		審査請求 未請求	R 請求項の数6 OL (全8頁)
21)出願番号	特願2000-201424(P2000-201424)	(71)出顧人 00000	5120
		日立電	線株式会社
(22)出顧日	平成12年6月29日(2000.6.29)	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	
		(72)発明者 大高	
	:	<b>茨城</b> 県	日立市日高町5丁目1番1号 日立
		電線棋	式会社総合技術研究所内
		(72)発明者 鈴木	幸夫
	•	茨城県	日立市日高町5丁目1番1号 日立
		電線棋	式会社総合技術研究所内
	•	(74)代理人 100116	5171
	•	<b>护理士</b>	二川澄 茂
		Fターム(参考) 5F	7044 AAD8
	*		

## (54) 【発明の名称】 スティフナ付きTABテープ及びそれを用いた半導体装置

## (57)【要約】

【課題】従来の2メタル1基材TABテープを用いた場合と同等の電気特性を有する安価なティフナ付きTABテープ及びそれを用いたTBGA半導体装置を提供すること。

【解決手段】第1テープ基材1の片面上に回路パターン21を形成し、その一部を絶縁膜2で覆い、ビア用接続領域部分25にビアホール12を設けて構成した1メタルTABテープ20と、第2テープ基材15の片面に金属箔層14を設けた第2メタル用テープ30とを、接着削層5を介して貼り合わせ、ビアホールのホール上縁のビア用接続領域部分25とホール底の金属箔層14の部分とを導電手段(4、16、18)により電気的に接続すると共に、1メタルTABテープ20により覆われていない金属箔層14の露出部分32を、半導体素子7のグランドラインの電極71にボンディングワイヤ83により接続し、グランド電位に落とす。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】絶縁フィルムから成る第1テープ基材の片 面上に信号回路を持つ回路パターンを形成し、該回路パ ターンの一部を絶縁膜で覆い、その絶縁膜で覆われてい ない電気的接続が必要となる接続領域の1つであるビア 用接続領域部分に、上記第1テープ基材を貫くビアホー ルを設けて1メタルTABテープを構成し、この1メタ ルTABテープと、絶縁フィルムから成る第2テープ基 材の片面に金属箔層を設けた第2メタル用テープとを、 上記ピアホールに対応する開口の設けられた接着剤層を 介して、上記第1テープ基材の他方の片面側に上記第2 メタル用テープの金属箔層が位置するように貼り合わ せ、その際、上記金属箔層に上記1メタルTABテープ により覆われていないワイヤボンディング用の露出部分 を残し、上記貼り合わせにより得られた2メタル2基材 TABテープの第2メタル用テープ側に、接着剤を介し て、金属板から成るスティフナを貼り合わせたことを特 徴とするスティフナ付きTABテープ。

【請求項2】上記1メタルTABテープのビア用接続領域部分から上記第1テープ基材のビアホール及び上記接 20 着剤層の開口を通って上記第2メタル用テープの金属箔層に達するブラインドビアホール内にて、ホール上縁のビア用接続領域部分と、ホール底の金属箔層の部分とを導電手段により電気的に接続したことを特徴とする請求項1記載のスティフナ付きTABテープ。

【請求項3】上記ブラインドビアホールの部分を、導電手段及びビア用接続領域部分を覆って樹脂で封止したことを特徴とする請求項1又は2記載のスティフナ付きTABテープ。

【請求項4】片面側に回路パターンを有し、且つその一 30 部にパンチ加工などによってビアホールが穿孔された1 メタルTABテープの直下に、同様に一部に上記ビアホールに対応する開口の設けられた接着剤層を介して、金属箔層を有する絶縁フィルムを貼り合わせ、これに接着剤を介して、金属板から成るスティフナを貼り合わせ、このスティフナに半導体素子を搭載し、上記ビアホール及び開口から成るブラインドビアホールに半田ボールを溶融搭載することにより、1メタルTABテープ直下の上記金属箔層に特定の電位を与え、さらにこの金属箔層における半導体素子に近い側の部分領域を、1メタルT 40 ABテープの境界から露出させ、その露出部分と半導体素子の電極とをボンディングワイヤにより接続したことを特徴とする半導体装置。

【請求項5】上記ブラインドビアホールに半田ボールを 溶融搭載する代わりに、上記ピアホールの上縁の周囲に ワイヤボンディング可能なピア用接続領域部分を形成 し、そのピア用接続領域部分と、ホール底の金属箔層 (銅箔)の部分とをボンディングワイヤにより接続し、 さらにこの接続部を樹脂で覆ったことを特徴とする請求 項4記載の半導体装置。 【請求項6】上記ブラインドビアホールに半田ボールを 溶融搭載する代わりに、上記ビアホール上に上記回路パ ターンの一部として接続リード部を延在させ、この接続 リード部を折り曲げて、上記ホール底の金属箔層の部分 に圧着又は溶接により固定したことを特徴とする請求項 4記載の半導体装置。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スティフナと称される放熱板兼補強板の付いたスティフナ付きTAB(Tape Automated Bonding)テープ及びこれを用いたテープBGA(Ball Grid Array)半導体装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】TABテープとしては、ボリイミド樹脂製絶縁フィルムをテープ基材としてその片面に配線パターンを形成した1メタルTABテープが一般的である。【0003】しかし、パソコンなどに搭載されるチップは高周波化が進んでおり、これに伴い伝送速度の早い回路の必要性が高まってきている。また、データ伝送の高速化に伴い、TABテープの微細ピッチ配線において、リード間の電磁界結合によるノイズ発生が新たな問題として現れ、無視できなくなってきた。例えば、30μmのスペースを離して配置したリード間にリンギング(共振)現象が発生してクロックパルスの信号波形が著しく崩れるという問題がある。

【0004】この問題の解決策としては、テープ基材の 配線パターンと反対側の面にグランド層を設け、パッケ ージ内のリードによる配線間の相互インダクタンスによ るノイズの影響が動作特性上問題とならないようにする ことが有効と考えられる。

【0005】そこで、これに対応したTABテープとして、ポリイミド樹脂製絶縁フィルムをテープ基材として、その上下の面に、それぞれ配線パターンを形成した2メタル(2層配線)TABテープが注目されている。【0006】この2メタルTABテープを用いた従来のT-BGA(Tape BGA)構造の半導体装置を図5に示す。

【0007】これは、まず、ボリイミド樹脂製絶縁フィルムから成るテープ基材1の片面に、半田ボールパッド部26、ボンディングパッド部27及び引き回しリード部を含む信号回路を持つ回路パターン21を形成し、且つ該回路パターン21の一部をフォトソルダレジスト(PSR)から成る絶縁膜2で絶縁し、テープ基材1の他方の片面にグランド層6を設け、このグランド層6に、導電性のビア部3を介して、上記半田ボールパッド部26及びボンディングパッド部27を電気的に接続することにより、2メタルTABテープ50を構成する。そして、この2メタルTABテープ50を、接着削5を介して、金属板の中央部に半導体チップ搭載用の凹部6

10

1を設けて成るスティフナ10と貼り合わせ、スティフナ付きTABテープとする。

【0008】次に、上記スティフナ10の凹部41に、接着剤として素子固定剤9を用いて半導体チップ7を貼り付け、この半導体チップ7の電極71と上記回路パターン21とをボンディングワイヤ8にて結線し、さらに上記半導体チップ7とボンディングワイヤ8とを封止樹脂100によって封止することで半導体装置を構成する。なお、各半田ボールパッド部26上には半田ボール4が搭載される。

【0009】上記構成によれば、薄い絶縁層であるテープ基材1の直下に電気伝導層であるグランド層6を存在しているので、信号回路の配線に高周波信号が負荷された際、グランド層6に、それぞれの配線に流れる電流により発生する磁束を打ち消すような方向に渦電流が流れる結果、見かけ上、配線のインダクタンスと誘導性クロストークを低減することができる。これにより、電気信号の信頼性及び伝播速度の高速化がはかられる。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、2メタ 20 ル1基材TABテープは非常に価格が高く、これを用いて製造したT-BGA半導体装置は、結果的に非常に高価なものとなっている。

【0011】そこで本発明の目的は、上記課題を解決し、電気特性を改善するために、通常のシングルメタルTABとグランド層のテープ材を貼り合わせた構造の2メタル2基材TABテープを用いることにより、従来の2メタル1基材TABテープを用いた場合と同等の電気信号の信頼性と伝搬速度の高速化を図ることができる安価なティフナ付きTABテープ及びそれを用いたT-B 30GA半導体装置を提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、次のように構成したものである。

【0013】(1)請求項1の発明に係るスティフナ付きTABテープは、絶縁フィルムから成る第1テープ基材の片面上に信号回路を持つ回路パターンを形成し、該回路パターンの一部を絶縁膜で覆い、その絶縁膜で覆われていない電気的接続が必要となる接続領域の1つであるビア用接続領域部分に、上記第1テープ基材を貫くビ 40アホールを設けて1メタルTABテープを構成し、この1メタルTABテープと、絶縁フィルムから成る第2テープ基材の片面に金属箔層を設けた第2メタル用テープとを、上記ビアホールに対応する開口の設けられた接着利層を介して、上記第1テープ基材の他方の片面側に上記第2メタル用テープの金属箔層が位置するように貼り合わせ、その際、上記金属箔層に上記1メタルTABテープにより覆われていないワイヤボンディング用の露出部分を残し、上記貼り合わせにより得られた2メタル2基材TABテープの第2メタル田テープ側に 接着初を 50

介して、金属板から成るスティフナを貼り合わせたこと を特徴とする。

【0014】このスティフナ付きTABテープによれば、製作が容易な1メタルTABテープと、絶縁フィルムから成る第2テープ基材の片面に金属箔層を設けた第2メタル用テープとを、上記ピアホールに対応する開口の設けられた接着剤層を介して、上記第1テープ基材の他面側に上記第2メタル用テープの金属箔層が位置するように貼り合わせた構造の2メタル2基材TABテープを用いているため、従来の2メタル1基材TABテープを用いた場合に較べ、非常に安価に製造することができる。

【0015】また、このスティフナ付きTABテープによれば、第1テープ基材の片面側に回路パターンの一部であるピア用接続領域部分を、また第1テープ基材の他面側に例えば銅箔から成る金属箔層の部分を備え、ピア用接続領域部分から第1テープ基材のピアホール及び接着剤層の開口を通って金属箔層に達するブラインドピアホールを設けた構成であるので、このブラインドピアホールにおいて、ホール上縁のピア用接続領域部分と、ホール底の金属箔層の部分とを電気的に接続することにより、金属箔層をグランド電位に落とすことができる。

【0016】このブラインドビアでの電気的接続をなす 手段としては、例えば次の3つがある。第1は、上記ブ ラインドビアに半田ボールを溶融搭載する方法である。 第2は、ビアホール上縁のビア用接続領域部分と、ブラ インドビアのホール底の金属箔層の部分とをボンディン グワイヤにより電気的に接続する方法である。第3は、 上記ビアホール上に回路パターンの一部として延在する 接続リード部を折り曲げて、ホール底の金属箔層の部分 に圧着又は溶接する方法である。

【0017】なお、上記金属箔層には、その一部(電気的接続のなされる部分)または全面にAu/Niめっきが施されていることが好ましい。

【0018】(2)請求項2の発明は、請求項1記載のスティフナ付きTABテープにおいて、上記1メタルTABテープのビア用接続領域部分から上記第1テープ基材のビアホール及び上記接着剤層の開口を通って上記第2メタル用テープの金属箔層に達するブラインドビアホール内にて、ホール上縁のビア用接続領域部分と、ホール底の金属箔層の部分とを導電手段により電気的に接続したことを特徴とする。

【0019】(3)請求項3の発明は、請求項1又は2 記載のスティフナ付きTABテープにおいて、上記ブラ インドビアホールの部分を、導電手段及びビア用接続領 域部分を覆って樹脂で封止したことを特徴とする。

合わせ、その際、上記金属箔層に上記1メタルTABテ 【0020】(4)請求項4の発明に係る半導体装置 してにより覆われていないワイヤボンディング用の露出 は、片面側に回路パターンを有し、且つ、その一部にパ お分を残し、上記貼り合わせにより得られた2メタル2 本材TABテープの第2メタル用テープ側に、接着剤を 50 TABテープの直下に、同様に一部に上記ビアホールに

対応する開口の設けられた接着剤層を介して、金属箔層を有する絶縁フィルムを貼り合わせ、これに接着剤を介して、金属板から成るスティフナを貼り合わせ、このスティフナに半導体素子を搭載し、上記ビアホール及び開口から成るブラインドビアホールに半田ボールを溶融搭載することにより、1メタルTABテープ直下の上記金属箔層に特定の電位を与え、さらにこの金属箔層における半導体素子に近い側の部分領域を、1メタルTABテープの境界から露出させ、その露出部分と半導体素子の電極とをボンディングワイヤにより接続したことを特徴10とする。

【0021】この半導体装置によれば、製作が容易な1メタルTABテープと第2メタル用テープとを接着剤層を介して貼り合わせた構成の2メタル2基材TABテープによるスティフナ付きTABテープを用いているため、従来の2メタル1基材TABテープを用いた半導体装置の場合に較べ、非常に安価に製造することができる。

【0022】また、ピアホール及び開口から成るブラインドピアホールに半田ボールを溶融搭載することにより、1メタルTABテープ直下の金属箔層に特定の電位を与えた構成であるので、1メタルTABテープの片面側の回路パターンにおけるリード間の電磁界結合によるノイズ発生を抑え、電気信号の信頼性及び伝搬速度の高速化を図ることができる。

【0023】さらにまた、金属箔層における半導体素子に近い側の部分領域(金属箔層部分)を、1メタルTABテープの領域外に露出させ、その露出部分をワイヤボンディングにより半導体素子の電極と接続しているので、半導体素子のグランドラインを上記金属箔層及びブ30ラインドビアホールを通して、グランド電位に落とすことができる。従って、この点でも伝送速度の高速化と動作特性の安定化が図られる。

【0024】なお、上記金属箔層には、その一部(電気的接続のなされる部分)または全面にAu/Niめっきが施されていることが好ましい。

【0025】(5)請求項5の発明は、請求項4記載の 半導体装置において、上記ブラインドビアホールに半田 ボールを溶融搭載する代わりに、上記ビアホールの上縁 の周囲にワイヤボンディング可能なビア用接続領域部分 40 を形成し、そのビア用接続領域部分と、ホール底の金属 箔層(銅箔)の部分とをボンディングワイヤにより接続 し、さらにこの接続部を樹脂で覆ったことを特徴とす

【0026】この特徴によれば、ブラインドビアホールにおけるビア用接続領域部分とホール底の金属箔層の部分との電気的接続を、素子電極と回路パターンとを結線するワイヤボンディング工程の一環として、ワイヤボンディングで行うことができる。また、その接続部を樹脂で覆っているので、十分に保護することができる。

【0027】(6)請求項6の発明は、請求項4記載の 半導体装置において、上記ブラインドビアホールに半田 ボールを溶融搭載する代わりに、上記ビアホール上に上 記回路パターンの一部として接続リード部を延在させ、 この接続リード部を折り曲げて、上記ホール底の金属箔 層の部分に圧着又は溶接により固定したことを特徴とす る。

【0028】この特徴によれば、ブラインドビアホールにおけるビア用接続領域部分とホール底の金属箔層の部分との電気的接続を、ビアホール上に回路パターンの一部として延在する接続リード部を、例えばフライングリードの形で設け、これをボンディングツールでS字状に折り曲げて、ホール底の金属箔層の部分に圧着又は溶接により固定する構成であるので、ボンディングワイヤを用いて2点ボンディングする必要がなくなり、ボンディング部分を金属箔層側の1箇所のみで済ますことができる。

## [0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図示の実施形態に 基づいて説明する。

【0030】図1に代表的な実施形態を示す。図1において、10は本発明により構成した2メタル2基材TABテープであり、図2に示すように、1メタルTABテープ20と第2メタル用テープ30とを、接着剤層5を介して貼り合わせたものから構成されている。

【0031】図2において、1メタルTABテープ20は、ボリイミド樹脂製絶縁フィルムから成る第1テープ基材1の片面上に、シグナルバッド部22、電源リング部23、半田ボールパッド部24及び引き回しリード部を含む信号回路を持つ回路パターン21を形成し、該回路パターン21の一部をフォトソルダレジスト(PSR)による絶縁膜2で覆った構成を有する。即ち、回路パターン21のうち、引き回しリード部は絶縁膜2で覆われているが、電気的接続が必要となる接続領域である、シグナルパッド部22、電源リング部23、半田ボールパッド部24といった部分は、絶縁膜2に覆われずに露出したまま残されている。

【0032】また、絶縁膜2で覆われていない電気的接続が必要となる接続領域の1つであるピア用接続領域部分25(ここでは半田ボールパッド部24の1つ)には、上記第1テープ基材1を貫くピアホール12を設けてある。

【0033】接着利層5は上記ピアホール12に対応する開口13を具備しており、上記1メタルTABテープ20の第1テープ基材1の他面側に、塗布又は貼付により設けられる。

【0034】この実施形態の場合、絶縁フィルムから成る第1テープ基材1の片面上に、シグナルパッド部22、電源リング部23、半田ボールパッド部24及び引き回しリード部を含む信号回路を持つ回路パターン21

を形成し、その電気的接続が必要な接続領域22~24 を残して回路パターンを絶縁膜2で絶縁し、第1テープ 基材1の他面側に接着剤層5を貼り付けた後、半田ボー ルパッド部24の少なくとも1つに対し、パンチ加工に より、当該半田ボールパッド部24、第1テープ基材1 及び接着剤層5を貫通するビアホール12、13を一括 で設けている。これは一工程で上記ビアホール12及び 開口13を設けることができるため、工程数を少なくす る上で非常に効果的である。

【0035】第2メタル用テープ30は、ボリイミド樹 10 脂製の絶縁フィルムから成る第2テープ基材15の片面に、グランド層(電気伝導層)として機能する銀箔層から成る金属箔層14を有する。この金属箔層14には、その全面にAu/Niめっきが施されているが、その一部即ち電気的接続のなされる部分にのみ設けることもできる。この第2メタル用テープ30に設けられるデバイス用ホール31の大きさは、1メタルTABテープ20に設けられるデバイス用ホール28より小さくなっている。このため、第2メタル用テープ30の金属箔層14は、半導体素子7に近い側の部分領域(金属箔層部分) 20が、距離して示す長さだけ、1メタルTABテープ20より長くなっている。

【0036】上記した1メタルTABテープ20と第2 メタル用テープ30とは、図1の如く、接着剤層5を介 して、第1テープ基材1の他方の片面側つまり回路パタ ーン21の存在しない側に、金属箔層14が位置するよ うに貼り合わせられる。その際、上記デバイス用ホール 28、31の大小関係から、第2メタル用テープ30の 金属箔層14には、1メタルTABテープ20により覆 われていないワイヤボンディング用の露出部分32が残 30 される。

【0037】上記貼り合わせにより得られた2メタル2基材TABテープ10には、その第2メタル用テープ30側に、接着剤35を介して、図1の如く、金属板から成るスティフナ40を貼り合わせ、以てスティフナ付きTABテープを完成する。

【0038】このスティフナ付きTABテープによれば、製作が容易な1メタルTABテープ20と第2メタル用テープ30とを接着剤層5を介して貼り合わせた構成の2メタル2基材TABテープ10を用いているため、従来の1つのテープ基材の両面に金属箔を有するものを加工した2メタル1基材TABテープを用いた場合に較べ、非常に安価に製造することができる。

のスティフナ付きTABテープはこの形態に限定される ものではない。即ち、1メタルTABテープ20のピア 用接続領域部分25から第1テープ基材1のビアホール 12及び接着剤層5の開口13を通って第2メタル用テ ープ30の金属箔層14に達するブラインドビアホール 11内において、ホール上縁のビア用接続領域部分25 と、ホール底の金属箔層14の部分とを導電手段により 電気的に接続し、その状態で完成品として扱うこともで きる。また、さらに、ブラインドビアホール11の部分 を、導電手段及びビア用接続領域部分25を覆って樹脂 で封止し、その状態で完成品として扱うこともできる。 【0040】図1は、ブラインドピアホール11での電 気的接続をなす手段として、ビアホール12及び開口1 3から成るブラインドピアホール11に半田ボール4を 溶融搭載することにより、1メタルTABテープ20直 下の金属箔層14に特定の電位を与えることを可能にし た構成を示している。

【0041】図3は、ブラインドビアホール11のホール上縁のビア用接続領域部分25と、ホール底の金属箔層14の部分とをボンディングワイヤ16によりボンディングして電気的に接続し、その接続部をモールド樹脂17で封止した構成を示す。

【0042】また、図4は、上記ブラインドビアホール 11のホール上に回路パターン21の一部としてフライ ングリードの形で延在する接続リード部18を設け、こ の接続リード部18を、ボンディングツールでS字状に 折り曲げて、ホール底の金属箔層14の部分に圧着又は 溶接により固定した構成を示す。図中、19は接続リー ド部18の溶接部を示す。

0 【0043】次に、上記2メタルTABテープ10を用いた半導体装置の構成について説明する。

【0044】図1の半導体装置の場合には、次のように組み立てる。まず、上記2メタルTABテープ10を用い、そのスティフナ40の凹部41に、素子固定剤9を介して半導体素子7を搭載する。そして、回路パターン21のシグナルパッド部22とこれに対応する半導体素子7の電極71のうちの信号用電極とをボンディングワイヤ82により接続し、回路パターン21の電源リング部23とこれに対応する半導体素子7の電極71のうちの電源用電極とをボンディングワイヤ83により接続する。

【0045】また、上記ビアホール12及び開口13から成るブラインドビアホール11に半田ボール4を溶融搭載することにより、ホール上縁のビア用接続領域部分25とホール底の金属箔層14の部分とを電気的に接続し、1メタルTABテープ20直下の金属箔層14に特定のグランド電位を与える。これにより、1メタルTABテープの片面側の回路パターン21におけるリード間の電磁界結合によるノイズ発生を抑え、伝搬速度の高速化を図ることができる。

【0046】さらに、この金属箔層14における半導体素子7に近い側の部分領域(金属箔層部分)を、1メタルTABテープ20の領域外へ露出させ、その露出部分32と半導体素子7の電極71のうちのグランド用電極とをボンディングワイヤ81により接続し、半導体素子7のグランドラインを金属箔層14及びブラインドビアホール11を通して、グランド電位に落とす。これにより、伝送速度の早い半導体素子7の動作特性の安定化を図ることができる。

【0047】そして、半導体チップ7の周辺領域におけ 10 る電気的な接続を保護するために、モールドレジン10 0は、半導体チップ7、ワイヤボンディング81,8 2,83、回路パターン21等を包み込むようにして封止している。この点は、後述する図3,4の半導体装置においても同様である。

【0048】図3の半導体装置の場合には、上記のようにブラインドビアホール11に半田ボール4を溶融搭載する代わりに、ビアホール12の上縁の周囲にワイヤボンディング可能なビア用接続領域部分25を形成し、そのビア用接続領域部分25とホール底の金属箔層14の20部分とをボンディングワイヤ16により接続し、さらにこの接続部をモールド樹脂17で覆って保護した構成を有する。この実施形態によれば、ブラインドビアホール11における電気的接続をボンディングワイヤ16により行っているため、このワイヤボンディングによる接続を、素子電極71と回路パターン21とを接続するワイヤボンディング工程の一環として行うことができる。

【0049】図4の半導体装置の場合には、上記のようにブラインドビアホール11に半田ボール4を溶融搭載する代わりに、ビアホール12上に回路パターン21の30一部として接続リード部18を、例えばフライングリードの形で延在させ、この接続リード部18を、ボンディングツールでS字状に折り曲げて、ホール底の金属箔層14の部分に圧着又は溶接により固定した構成を有する。この実施形態によれば、ボンディングワイヤを用いることなく、且つボンディング部分を金属箔層側の1箇所のみで済ますことができる。

## [0050]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、次 のような優れた効果が得られる。

【0051】(1)請求項1~3のスティフナ付きTABテープによれば、製作が容易な1メタルTABテープと、絶縁フィルムから成る第2テープ基材の片面に金属箔層を設けた第2メタル用テープとを、接着剤層を介して貼り合わせた構成の2メタル2基材TABテープを用いているため、従来の2メタルTABテープを用いた場合に較べ、非常に安価に製造することができる。

【0052】また、このスティフナ付きTABテープによれば、第1テープ基材の片面側に回路パターンの一部であるビア用接続領域部分を、また第1テープ基材の他 50

面側に金属箔層の部分を備え、ビア用接続領域部分から 第1テープ基材のビアホール及び接着剤層の開口を通っ て金属箔層に達するブラインドビアホールを設けた構成 であるので、このブラインドビアホールにおいて、ビア ホール上縁のビア用接続領域部分と、ブラインドビアホ

10

ホール上縁のピア用接続領域部分と、ブラインドピアホールのホール底の金属箔層の部分とを電気的に接続することにより、金属箔層をグランド電位に落とすことができる

【0053】(2)請求項4~6の半導体装置によれば、製作が容易な1メタルTABテープと第2メタル用テープとを接着剤層を介して貼り合わせた構成の2メタル2基材TABテープによるスティフナ付きTABテープを用いているため、従来の2メタルTABテープを用いた半導体装置の場合に較べ、非常に安価に製造することができる。

【0054】また、ビアホール及び開口から成るプラインドビアホールに半田ボールを溶融搭載することにより、又はビアホールの上縁周囲のビア用接続領域部分とホール底の金属箔層の部分とをワイヤボンディングし或いは接続リード部を溶接することにより電気的に接続して、1メタルTABテープ直下の金属箔層に特定の電位を与えた構造であるので、回路パターンにおけるリード間の電磁界結合によるノイズ発生を抑え、従来の2メタル1基材TABテープを用いた場合と同等の電気信号の信頼性及び伝搬速度の高速化を図ることができる。

【0055】さらにまた、金属箔層における半導体素子 に近い側の部分領域を、1メタルTABテープの領域外 に露出させ、その露出部分をワイヤボンディングにより 半導体素子の電極と接続しているので、半導体素子のグ ランドラインを上記金属箔層及びブラインドビアホール を通して、グランド電位に落とすことができる。従っ て、この点でも伝送速度の高速化と動作特性の安定化が 図られる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る半導体装置の右半分の構成を示す断面図である。

【図2】本発明のスティフナ付きTABテープの構成要素である2メタル2基材TABテープの1メタルTABテープと第2メタル用テープとの貼り合わせ工程を示し40 た図である。

【図3】本発明の第2の実施形態に係る半導体装置の右半分の構成を示す断面図である。

【図4】本発明の第3の実施形態に係る半導体装置の右半分の構成を示す断面図である。

【図5】従来の半導体装置の右半分の構成を示す断面図である。

## 【符号の説明】

- 1 第1テープ基材
- 2 絶縁膜
- 50 4 半田ボール

11

5 接着剤層

7 半導体素子

10 2メタル2基材TABテープ

11 ブラインドピアホール

12 ピアホール

13 開口

14 金属箔層

15 第2テープ基材

16 ボンディングワイヤ

17 モールド樹脂

18 接続リード部

20 1メタルTABテープ

21 回路パターン

22 シグナルパッド部

24 半田ボールパッド部

25 ピア用接続領域部分

30 第2メタル用テープ

32 露出部分

35 接着剤

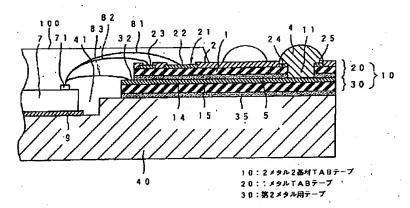
40 スティフナ

71 電極

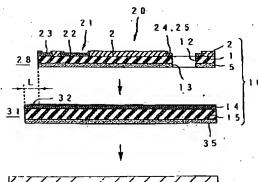
10 81、82、83 ボンディングワイヤ

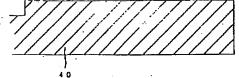
100 モールドレジン

【図1】

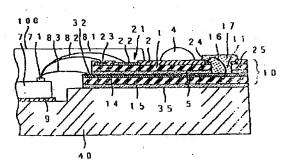


【図2】

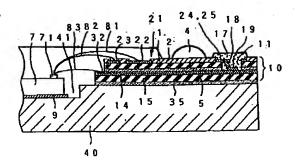




【図3】



【図4】



【図5】

